

2016年1月22日



2016年 新春 電子顕微鏡解析技術フォーラム プログラム

「電子線、放射光のプロから学ぶ使い方 ～原理・基礎から実用材料への適用まで～」

時間	テーマ / 内容	会場
10:00 ~ 10:30	受付開始	
10:30 ~ 10:40	挨拶とオリエンテーリング 高橋 知里(愛知学院大)	あいち産業科学技術総合センター1F 講習会室A~C
	[チュートリアル] 座長:今野 充(日立ハイテクノロジーズ)	
10:40 ~ 11:50	EELS分析の基礎と応用 京都大学 化学研究所 倉田 博基 様	
11:50 ~ 13:00	昼食	3F コミュニケーションスペース
	[トピックス] 座長:和田 充弘(三井金属), 元井 泰子(キヤノン)	
13:00 ~ 13:35	XAFSを用いた触媒構造と反応過程に関する研究 産業技術総合研究所 無機機能材料研究部門 多井 豊 様	1F 講習会室A~C
13:35 ~ 14:10	放射光X線と透過型電子顕微鏡による金属中微細粒子のサイズ評価 東京工業大学 宮澤 知孝様	
14:10 ~ 14:45	軟X線領域のシンクロトロン放射光を材料分析に用いる利点について 名古屋大学 未来材料・システム研究所 八木 伸也 様	
14:45 ~ 15:05	休憩	2F ロビー
	[ざっくばらんトーク&見学会] 司会:乾 光隆(セイコーエプソン)	
15:05 ~ 15:15	あいちシンクロトロン光センター竹田美和所長の挨拶と施設紹介	
15:15 ~ 16:15	施設見学(2班に分かれて下記3か所の見学) 1)あいち産業科学技術総合センター 3Dプリンター 2)あいち産業科学技術総合センター 計測分析室 3)あいちシンクロトロン光センター	あいちSR光センター、あいち産業科学技術総合センター
16:15 ~ 17:35	ざっくばらんトーク	1F 講習会室A~C
17:35 ~ 17:40	閉会の挨拶 長澤 忠広(ライカマイクロシステムズ)	
	[懇親会] 司会:久芳 聡子(日本電子)	
17:50 ~ 19:15	懇親会	3F コミュニケーションスペース

日本顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会